

СЕЛЕКТИВНЫЙ ЗАХВАТ МЕЖУЗЕЛЬНЫХ АТОМОВ УГЛЕРОДА В ОБЛУЧЕННОМ КРЕМНИИ

Маркевич В. П., Мурин Л. И.

Исследован отжиг межузельных атомов углерода (C_I) в кристаллах кремния с различным содержанием кислорода (O_I) и углерода (C_S) после облучения γ -квантами ^{60}Co или быстрыми электронами ($E \approx 4$ МэВ) при $T_{\text{об.}} \leq 280$ К. Показано, что для небольших доз облучения C_S и O_I являются основными стоками для C_I . Оценено отношение радиусов захвата C_I атомами углерода и кислорода ($r_{C_I-O_I}/r_{C_I-C_S} \approx 3$). Получено прямое экспериментальное подтверждение принадлежности комплексу C_I-C_S акцепторного уровня $E_c - 0.16$ эВ.

Изменение электрических и оптических свойств кристаллов Si, подвергнутых термообработке или облучению, в значительной мере определяется содержанием примесных атомов кислорода и углерода [1, 2]. Ранее было показано [3–5], что в кристаллах облученного кремния одними из основных электрически активных радиационных дефектов (РД) являются углеродосодержащие центры: межузельные атомы углерода (C_I) при $T_{\text{об.}} \leq 300$ К и комплексы межузельного углерода с углеродом замещения (C_I-C_S) и кислородом (C_I-O_I) при $T_{\text{об.}} \geq 300$ К. В настоящей работе проведено более детальное изучение процесса отжига C_I в кристаллах кремния с различным содержанием углерода и кислорода, облученных небольшими дозами γ -квантов ^{60}Co или быстрых электронов ($E \approx 4$ МэВ) при $T_{\text{об.}} \leq 280$ К. Концентрация кислорода и углерода определялась оптическим методом [6], концентрация РД — из температурных ($T_{\text{изм.}} = 77 \pm 400$ К) зависимостей концентрации носителей тока (акцепторные уровни C_I и C_I-C_S расположены у $E_c - 0.12$ и $E_c - 0.16$ эВ соответственно [3, 4]). Использовались кристаллы n -кремния с $n_0 = 10^{12} \pm 10^{14}$ см $^{-3}$, полученные методом Чохральского (тянутые) или бестигельной зонной плавки (зонные).

На рис. 1 представлены зависимости неотожженной доли дефектов с уровнем $E_c - 0.12$ эВ ($D_{0.12}$), т. е. межузельных атомов углерода, от времени отжига при различных температурах в тянутом (a) и зонном (б) кремнии. Линейный характер изменения доли $f = N_{C_I}/N_{C_{I_0}}$ в полулогарифмическом масштабе свидетельствует о том, что концентрация дефектов уменьшается со временем отжига по закону

$$N_{C_I} = N_{C_{I_0}} \exp(-t/\tau), \quad (1)$$

где $N_{C_{I_0}}$ — концентрация $D_{0.12}$ до отжига, τ — постоянная времени отжига.

На рис. 2 показаны зависимости τ от температуры отжига для этих же материалов. Данные зависимости имеют вид

$$\tau = v^{-1} \exp(\Delta E/kT), \quad (2)$$

где v — так называемый частотный фактор, ΔE — энергия активации отжига. Видно, что энергии активации отжига (наклон кривых) практически совпадают для обоих материалов, а «частотные» факторы существенно различаются. Расчет

показывает, что $\Delta E = 0.77 \pm 0.05$ эВ, а $\nu = 2.3 \cdot 10^7$ и $9.1 \cdot 10^9$ с⁻¹ для зонного и тянутого кристаллов соответственно. Совокупность полученных данных указывает на возможность описания отжига C_I квазихимическими реакциями типа

$$dN_{C_I}/dt = -N_{C_I} \sum_m k_{C_I-m} N_m, \quad (3)$$

где N_m — концентрация примесей (дефектов) определенного типа, являющихся стоками для C_I , причем $N_m = \text{const}$ в процессе отжига, k_{C_I-m} — константа скорости (вероятность) реакции взаимодействия C_I со стоком m -типа.

Основными стоками для C_I , как известно, могут быть примесные атомы кислорода, углерода, A - и E -центры, дивакансии и т. п. [7]. В наших экспериментах заметного изменения концентрации A -, E -центров и дивакансий при отжиге C_I не наблюдалось (концентрация этих РД не превышала 10^{14} см⁻³).

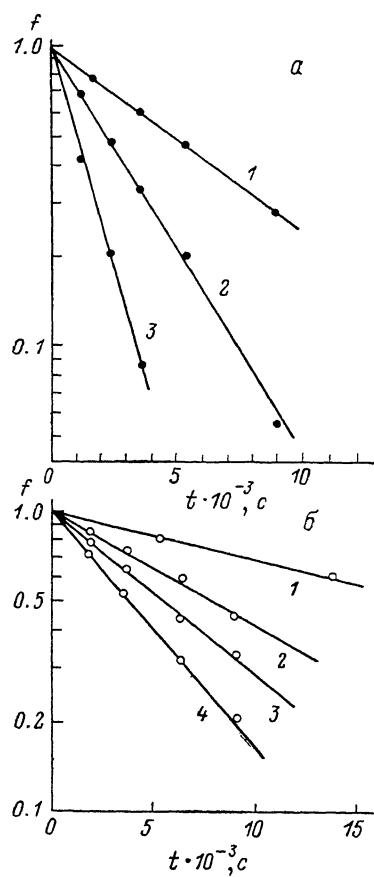


Рис. 1. Зависимости доли неотожженных дефектов с уровнем $E_c = 0.12$ эВ в тянутом (а) и зонном (б) кремнии от времени отжига при различных температурах.

$\Phi_{\text{об}} = 3.8 \cdot 10^{16}$ см⁻²; $T_{\text{об}} \approx 200$ К. а — КЭФ-60; $N_O \approx 6.6 \cdot 10^{17}$ см⁻³, $N_C \approx 6.0 \cdot 10^{16}$ см⁻³; $T_{\text{отж.}}$, К: 1 — 282, 2 — 289, 3 — 296. б — БКЭФ-60; $N_O < 10^{11}$ см⁻³, $N_C \approx 5.0 \cdot 10^{15}$ см⁻³; $T_{\text{отж.}}$, К: 1 — 331, 2 — 341, 3 — 346, 4 — 351.

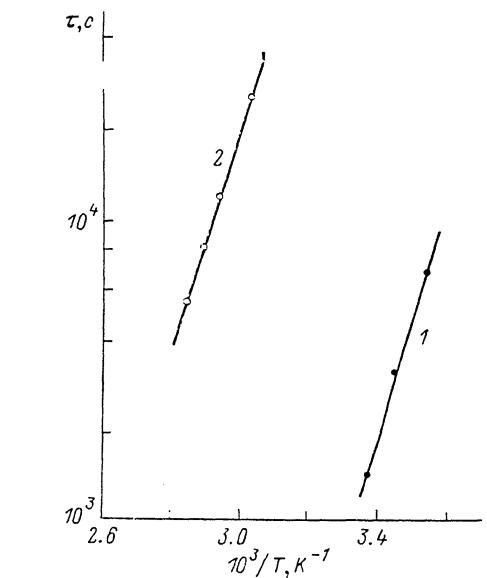


Рис. 2. Зависимости постоянной времени отжига C_I от температуры для тянутого (1) и зонного (2) кремния.

Поэтому можно было предполагать, что основными стоками для C_I в исследуемых кристаллах являются C_S и O_I , т. е.

$$dN_{C_I}/dt = -k_{C_I-O_I} N_{C_I} N_{O_I} - k_{C_I-C_S} N_{C_I} N_{C_S}, \quad (4)$$

откуда

$$N_{C_I} = N_{C_{I_0}} \exp [-(k_{C_I-O_I} N_{O_I} + k_{C_I-C_S} N_{C_S}) t]. \quad (5)$$

Таким образом, постоянная времени τ в выражении (1) есть не что иное, как

$$\tau^{-1} = k_{C_I-O_I} N_{O_I} + k_{C_I-C_S} N_{C_S}. \quad (6)$$

Далее, поскольку отжиг C_I лимитируется диффузией C_I , то, согласно теории реакций, лимитируемых диффузией [2], константу скорости можно записать в виде

$$k_{C_I-O_I} = 4\pi r_{C_I-O_I} D, \quad k_{C_I-C_S} = 4\pi r_{C_I-C_S} D,$$

где $r_{C_I-O_I}$ и $r_{C_I-C_S}$ — радиусы захвата C_I атомами кислорода и углерода соответственно, $D = D_0 \exp(-\Delta E/kT)$ — коэффициент диффузии межузельных атомов углерода. Следовательно,

$$\gamma^{-1} = 4\pi D_0 (r_{C_I-O_I} N_{O_I} + r_{C_I-C_S} N_{C_S}) \exp(-\Delta E/kT). \quad (7)$$

Сравнение (7) с (2) позволяет получить выражение для «частотного» фактора отжига C_I . В кристаллах с $N_O \gg N_C$ «частотный» фактор

$$\gamma = 4\pi r_{C_I-O_I} N_{O_I}. \quad (8)$$

Если $N_C \gg N_O$, то

$$\gamma = 4\pi r_{C_I-C_S} N_{C_S}. \quad (9)$$

Для проверки выполнения данных соотношений исследовались кристаллы трех типов: I — с $N_O \gg N_C$, II — с $N_C \gg N_O$, III — с $N_O \approx N_C$. На рис. 3 показаны экспериментальные зависимости «частотных» факторов отжига C_I от концентрации кислорода в кристаллах I типа (кривая 1) и углерода в кристаллах II типа (кривая 2). Видно, что γ линейно растет с увеличением концен-

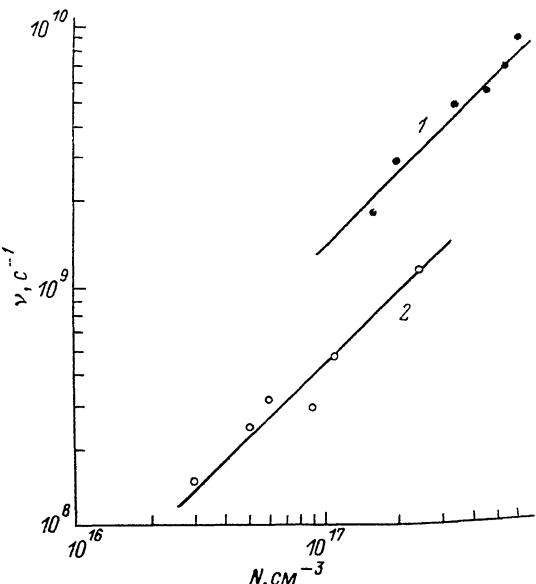


Рис. 3. Зависимости «частотных» факторов отжига межузельных атомов углерода от содержания кислорода (1) и углерода (2) в кристаллах $n\text{-Si}$ с $N_O \gg N_C$ (1) и $N_C \gg N_O$ (2).

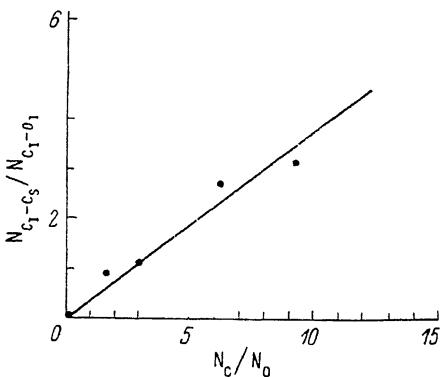


Рис. 4. Зависимость отношения концентраций комплексов C_I-C_S и C_I-O_I после полного отжига C_I от отношения концентраций углерода и кислорода в кристаллах.

Концентрация комплекса C_I-O_I определялась как $N_{C_I-O_I} = N_{C_I_0} - N_{C_I-C_S}$.

трации данных примесей. Этот факт прямо свидетельствует о том, что атомы кислорода и углерода являются основными стоками для межузельных атомов углерода.

Ранее было показано [3–5], что в кремнии с низким содержанием кислорода при отжиге C_I в такой же концентрации образуется дефект с уровнем $E_c = 0.16$ эВ ($D_{0.16}$). Был сделан вывод о принадлежности этого уровня комплексу C_I-C_S . В кристаллах с $N_C \gg N_O$, исследованных в настоящей работе, наблюдалась практическая полная перестройка $D_{0.12}$ в $D_{0.16}$. При этом скорость образования $D_{0.16}$ (или отжига $D_{0.12}$) для данной концентрации C_I была прямо пропорцио-

нальна концентрации C_s . Это служит прямым экспериментальным подтверждением идентификации уровня $E_c - 0.16$ эВ как акцепторного уровня комплекса $C_I - C_s$.

Из приведенных на рис. 3 данных можно оценить отношение вероятностей захвата C_I углеродом и кислородом. Для O_I эта вероятность примерно в 3 раза выше, чем для C_s . Такую же величину дает и зависимость отношения концентраций комплексов $C_I - C_s$ и $C_I - O_I$, измеренного после полного отжига C_I , от отношения концентраций кислорода и углерода в кристаллах III типа (рис. 4). Полученное значение $r_{C_I-O_I}/r_{C_I-C_s}$ существенно отличается от приведенного в [7], где эта величина равна 0.3. Такое различие может быть обусловлено неоднозначностью обработки экспериментальных данных в [7], поскольку в этой работе исследовалась кинетика накопления РД при больших дозах облучения, когда концентрация РД была сравнима с концентрацией кислорода и углерода. Для таких доз облучения комплексы $C_I - C_s$, $C_I - O_I$, A -центры и другие РД могут быть эффективными стоками (центрами непрямой аннигиляции) как для первичных дефектов (вакансий и собственных межузельных атомов кремния), так и для C_I , что приводит к нелинейному накоплению дефектов и существенно затрудняет интерпретацию экспериментальных зависимостей. В нашем же случае концентрация введенных РД была намного меньше концентрации O_I и C_s , эти примеси являлись основными стоками для межузельных атомов углерода, накопление комплексов $C_I - C_s$ и $C_I - O_I$ с дозой облучения происходило по линейному закону. Это позволило с достаточно высокой степенью точности определить отношение вероятностей захвата C_I кислородом и углеродом.

Л и т е р а т у р а

- [1] Рейви К. Дефекты и примеси в полупроводниковом кремнии. М., 1984. 475 с.
- [2] Винецкий В. Л., Холодарь Г. А. Радиационная физика полупроводников. Киев, 1979. 336 с.
- [3] Литвинко А. Г., Макаренко Л. Ф., Мурин Л. И., Ткачев В. Д. — ДАН БССР, 1979, т. 23, в. 6, с. 522—524.
- [4] Литвинко А. Г., Макаренко Л. Ф., Мурин Л. И., Ткачев В. Д. — ФТП, 1980, т. 14, в. 4, с. 776—780.
- [5] Murin L. I. — Phys. St. Sol. (a), 1986, v. 93, N 1, p. K147—K149; 1987, v. 101, N 2, p. K107—K110.
- [6] Ильин М. А., Коварский В. Я., Орлов А. Ф. — Зав. лаб., 1984, № 1, с. 24—32.
- [7] Davis G., Oates A. S., Newman R. C. et al. — J. Phys. C: Sol. St. Phys., 1986, v. 19, p. 841—855.

Институт физики твердого тела
и полупроводников АН БССР
Минск

Получена 20.08.1987
Принята к печати 15.12.1987